

① 概要

各種材料の微細な構造をナノオーダーで評価することが可能です。

② 主な仕様

- (1) 点分解能 : 0.23nm、線分解能 : 0.10nm
- (2) 最小スポット径 : 0.5nm
- (3) 倍率 : 2,000~1,500,000

③ 特徴

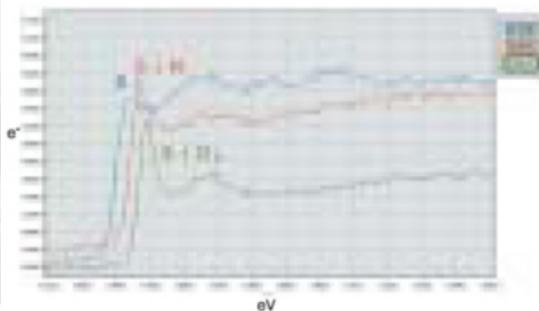
- (1) 高分解能を有するHAADF-STEM (高角度環状暗視野走査透過電子顕微鏡法) を駆使し、電子線の干渉の影響を受けない原子番号に依存したコントラストがえられます。
- (2) STEM機能とEDS機能を組み合わせることで、構成元素の定量マッピング像をえることが可能です。
- (3) STEM機能とEELS機能を組み合わせることで、ナノオーダーの空間分解能で元素マッピングが可能です。
- (4) TEMトモグラフィシステムを搭載しており、三次元像を構築することが可能です。

④ 利用分野

電子デバイスから構造材料まで各種先端分野に対応



FE-TEM
(JEM-2100F)



EELSによる半導体デバイスの微小部状態分析例